1/9/2 DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

012556409 **Image available** WPI Acc No: 1999-362515/199931 XRPX Acc No: N99-270533

Substrate structure for optical disc - has protrusion with height more than quarter times wavelength of light, which is not formed on signal, recorded area

Patent Assignee: JAPANESE GEON CO LTD (JAPG); SONY CORP (SONY);

NIPPON ZEON KK (JAPG)

Inventor: ISHIDA T; KOHARA T; OSHIMA M; SASA T; TAKAHASHI H

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Date Kind Applicat No Kind Date Week JP 97298836 JP 11134711 19990521 19971030 199931 Α Α SG 77203 $\mathbf{A}\mathbf{1}$ 20001219 SG 984334 19981028 200106

Priority Applications (No Type Date): JP 97298836 A 19971030

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 11134711 A 14 G11B-007/24 SG 77203 A1 G11B-007/24

Abstract (Basic): JP 11134711 A

NOVELTY - A protrusion is formed on the substrate (11) such that the height measured from substrate surface is more than quarter time the wavelength of the light and is not formed on the signal recording area. DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for the substrate manufacturing method.

USE - For optical disk, magneto-optical disk, and phase change type optical disk.

ADVANTAGE - Reliability is improved as collision with optical head is prevented by forming protrusion unit in non- recording area and hence high density recording and regeneration is performed. Sufficient productivity and fabrication is achieved without expense as substrate is formed by injection molding of resin. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the cross- sectional chart showing the disc substrate on which protrusion is formed. (11) Substrate.

Dwg. 2/6

Title Terms: SUBSTRATE; STRUCTURE; OPTICAL; DISC; PROTRUDE; HEIGHT; MORE; QUARTER; TIME; WAVELENGTH; LIGHT; FORMING; SIGNAL; RECORD; AREA

Derwent Class: T03; W04

International Patent Class (Main): G11B-007/24

International Patent Class (Additional): G11B-007/0037; G11B-007/26;

G11B-011/16; G11B-011/18

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): T03-B01; T03-B01E; W04-C01; W04-C01E

1/9/2 DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06193159 **Image available**

SUBSTRATE FOR DISK-SHAPED RECORDING MEDIUM, PRODUCTION OF SUBSTRATE FOR DISK-SHAPED RECORDING MEDIUM AND DISK DEVICE

PUB. NO.: 11-134711 [JP 11134711 A] PUBLISHED: May 21, 1999 (19990521)

INVENTOR(s): SASA TAKESHÌ ISHIDA TAKEHISA OSHIMA MASAYOSHI

OBARA TEIJI

TAKAHASHI HARUHIKO

APPLICANT(s): SONY CORP

NIPPON ZEON CO LTD

APPL. NO.: 09-298836 [JP 97298836] FILED: October 30, 1997 (19971030)

INTL CLASS: G11B-007/24; G11B-007/24; G11B-007/26

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate for a disk-shaped recording medium which enables recording and reproducing with high reliability without collision against a floating type optical disk, a process for producing the same as well as a disk device which executes recording and/or reproducing with the disk-shaped recording medium formed by using this substrate.

SOLUTION: The disk substrate 11 used for, for example, a magneto-optical disk 10 is formed by molding a resin to a disk form by controlling the number of particles of ≥ 2.0 μ m in grain size in a molding so as to attain ≤ 10000 pieces/g. The formation of the projections at which the height measured from the average surface attains 1/4 the wavelength of the beam to be used is averted.

COPYRIGHT: (C)1999, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-134711

(43)公開日 平成11年(1999)5月21日

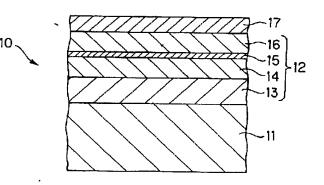
(51) Int. Cl. 6	識別記号	FΙ	
G11B 7/24	531	G11B 7/2	24 531 Z
	526		526 M
			526 Z
7/26	521	• 7/2	26 521
		審査請す	求 未請求 請求項の数11 OL (全14頁)
(21)出願番号	特願平9-298836	(71)出願人	000002185
			ソニー株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)10月30日		東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(71)出願人	. 000229117
			日本ゼオン株式会社
			東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
		(72)発明者	佐々 剛
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
			一株式会社内
		(72)発明者	石田 武久
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
			一株式会社内
		(74)代理人	弁理士 小池 晃 (外2名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ディスク状記録媒体用基板、ディスク状記録媒体用基板の製造方法並びにディスク装置

(57) 【要約】

【課題】 浮上型光学ヘッドと衝突することがなく、信頼性の高い記録再生を可能とするディスク状記録媒体用基板及びその製造方法並びにこの基板を用いたディスク状記録媒体に対して記録及び/又は再生を行うディスク装置を提供する。

【解決手段】 例えば光磁気ディスク10に用いられるディスク基板11において、基板表面には、その平均面から測定した高さが、使用されるレーザビームの波長の1/4以上となる突起が形成されないようにする。



光磁気ディスクの断面図

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光を使用して記録及び/又は再生が行われるディスク状記録媒体に用いられるディスク状記録媒体用基板において、

少なくとも信号が記録される領域には、基板表面から測定した高さが上記光の波長の1/4以上となる突起が形成されていないことを特徴とするディスク状記録媒体用基板。

【請求項2】 上記ディスク状記録媒体は、基板上に少なくとも信号記録層と保護層とが順次積層されてなり、上記保護層を透過した光が上記信号記録層上に照射されることにより所定の情報信号の記録及び/又は再生が行われるディスク状記録媒体であることを特徴とする請求項1記載のディスク状記録媒体用基板。

【請求項3】 樹脂を射出成形することにより形成されていることを特徴とする請求項1記載のディスク状記録媒体用基板。

【請求項4】 上記樹脂は熱可塑性ノルボルネン系樹脂であることを特徴とする請求項3記載のディスク状記録 媒体用基板。

【請求項5】 光を使用して記録及び/又は再生が行われるディスク状記録媒体に用いられるディスク状記録媒体用基板を製造するに際し、

樹脂を成形体中の粒径 2.0 μm以上の粒子の数が 10000個/g以下となるように制御してディスク状に成形し、少なくとも信号が記録される領域には、基板表面から測定した高さが上記光の波長の 1/4以上となる突起が形成されていないディスク状記録媒体用基板を製造することを特徴とするディスク状記録媒体用基板の製造方法。

【請求項6】 上記樹脂を射出成形してディスク状記録 媒体用基板を製造することを特徴とする請求項5記載の ディスク状記録媒体用基板の製造方法。

【請求項7】 上記樹脂は熱可塑性ノルボルネン系樹脂であることを特徴とする請求項5記載のディスク状記録媒体用基板の製造方法。

【請求項8】 ディスク状記録媒体を回転駆動させるモータと、

上記モータにより回転駆動されるディスク状記録媒体上を、使用する光の波長の1/4以内の浮上量で浮上して、このディスク状記録媒体に対して情報信号の書き込み又は読み出しを行う浮上型光学ヘッドとを備え、

上記ディスク状記録媒体の少なくとも信号が記録される 領域には、その表面から測定した高さが、上記光の波長 の1/4以上となる突起が形成されていないことを特徴 とするディスク装置。

【請求項9】 上記ディスク状記録媒体の基板は、樹脂を射出成形することにより成形されていることを特徴とする請求項8記載のディスク装置。

【請求項10】 上記ディスク状記録媒体の基板は、熱 50 ら測定した高さが上記光の波長の1/4以上となる突起

可塑性ノルボルネン系樹脂からなることを特徴とする請求項8記載のディスク装置。

【請求項11】 上記ディスク状記録媒体の基板は、上記樹脂に内在する粒径2.0 μ m以上の粒子の数が10000個/g以下となるように制御して成形されていることを特徴とする請求項9記載のディスク装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光を使用して記録 及び/又は再生が行われるディスク状記録媒体に用いら れるディスク状記録媒体用基板及びその製造方法並びに ディスク装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、再生専用光ディスク、光磁気ディスク、相変化型光ディスク等のように、光を用いて情報信号の読み出しや書き込みが行われるディスク状記録媒体が普及している。

【0003】これらのディスク状記録媒体に対して情報信号の記録及び/又は再生を行うディスク装置は、例え 20 ば再生時においては、半導体レーザからレーザビームを出射して、このレーザビームを光学系を用いて絞り込み、装着されたディスク状記録媒体の信号記録面上に焦点を合わせて照射し、その反射光を検出することにより、ディスク状記録媒体に記録された情報信号を読み出すようにしている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような 光を用いてディスク状記録媒体に対して情報信号の読み 出しや書き込みを行うシステムが普及する中で、このシ 30 ステムに用いられるディスク状記録媒体は、記録密度の 向上と信頼性の向上とが求められている。

【0005】しかしながら、このようなシステムにおいては、記録密度の向上を図るべく、光学ヘッドをディスク状記録媒体に近接させた場合に、光学ヘッドとディスク状記録媒体が衝突してしまう可能性があり、このような光学ヘッドとディスク状記録媒体との衝突がディスク状記録媒体の信頼性を損う大きな要因となっていた。

【0006】そこで、本発明は、高密度で信頼性の高いディスク状記録媒体を得ることができるディスク状記録 40 媒体用基板及びその製造方法並びにこの基板を用いたディスク状記録媒体に対して記録及び/又は再生を行うディスク装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係るディスク状記録媒体用基板は、上述した課題を解決すべく創案されたものであって、光を使用して記録及び/又は再生が行われるディスク状記録媒体に用いられるディスク状記録媒体の信号が記録される領域に対応した領域には、基板表面から測定した高さが上記光の波長の1/4以上となる空起

が形成されていないことを特徴とするものである。

į,

【0008】ディスク状記録媒体は、このディスク状記 録媒体用基板を基板として用いることにより、少なくと も信号が記録される領域を、光の波長の1/4以上とな る突起のない平滑な平面とすることができ、光学ヘッド が近接した場合であっても、光学ヘッドとの衝突が回避 され、信頼性の向上及び高密度記録が可能となる。

【0009】特に、近年、ニアフィールド記録と呼ばれ る記録再生方式を用いて、レーザビームのスポット径を 小さくし、ディスク状記録媒体の高密度記録化を図るよ 10 うにしたシステムが提案されている。

【0010】この二アフィールド記録は、レーザビーム が屈折率nの高いレンズを透過したときに、このレンズ から極めて近接した領域において得られる、スポットが 1/n に絞られた漏れ光を利用して記録再生を行うもの である。このとき、記録再生を行うために必要な出力を もつ漏れ光が得られるのは、レンズからの距離がλ/4 程度までの領域である。

【0011】したがって、例えばディスク状記録媒体に 対して記録及び/又は再生を行うために使用される光の 20 波長んが約659nmである場合、ニアフィールド記録 により高密度記録を図るためには、光学ヘッドをディス ク状記録媒体の信号記録面から約165nm (λ/4) 以内の浮上量で浮上させて、記録及び/又は再生を行う 必要がある。

【0012】このとき、ディスク状記録媒体の信号が記 録される領域に約165nm (λ/4)以上の高さの突 起が存在すると、このディスク状記録媒体は、突起が原 因となって光学ヘッドと衝突し、光学ヘッドの損傷ある いはディスク状記録媒体自体の損傷を招いてしまう場合 30 がある。

【0013】本発明に係るディスク状記録媒体用基板を 用いたディスク状記録媒体は、少なくとも信号が記録さ れる領域が、光の波長の1/4以上となる突起のない平 滑な平面とされるので、この二アフィールド記録により 記録及び/又は再生を行うようにしても光学ヘッドとの 衝突が回避され、信頼性を損なうことなく記録密度を大 幅に向上させることができる。

【0014】また、本発明に係るディスク状記録媒体用 基板は、樹脂を射出成形することにより形成されている 40 ことが望ましい。

【0015】ディスク状記録媒体用樹脂基板は、樹脂を 射出成形して形成されることにより、ディスク表面にへ ッド位置決め情報やアドレス情報のための凹部が設けら れたディスク状記録媒体やトラック間にグルーブを有す るディスク状記録媒体用の基板として、精度良く且つ容 易に形成することができ、ハードディスク等で用いられ ているアルミニウム基板に比べて生産性良く且つ低コス トで製造することができる。

基板は、熱可塑性ノルボルネン系樹脂を射出成形するこ とにより形成されていることが、より望ましい。

【0017】ディスク状記録媒体用基板の材料として、 例えばポリカーボネートやメチルメタクリレート等を用 いた場合、吸湿によりディスク状記録媒体用基板に大き な変形を生じさせてしまうことがあり、光学ヘッドを近 接させて記録及び/又は再生を行うディスク状記録媒体 に用いる基板の材料としては必ずしも適当とはいえな い。また、低吸湿性のプラスチック材料を用いた場合で あっても、ポリメチルペンテンやボリスチレン等では、 結晶性で成形後にディスク状記録媒体用基板に変形を生 じさせてしまったり、耐熱性が不十分であったり等の問 題がある。

【0018】これに対して、ディスク状記録媒体用基板 の材料として、熱可塑性ノルボルネン系樹脂を用いた場 合は、十分な耐熱性が得られ、吸湿や結晶性による変形 もほとんどなく、光学ヘッドを近接させて記録及び/又 は再生を行うディスク状記録媒体用の基板として最適な ディスク状記録媒体用基板が得られる。

【0019】また、本発明者は、上述した課題を解決す べく、基板表面に、使用される光の波長の1/4以上の 突起が存在するディスク状記録媒体用基板 1 を子細に観 察したところ、図1に示すように、突起の直下部には異 物粒子2が存在し、この異物粒子2が原因となって、そ の粒径Dに応じた高さHを有する突起が生ずることを見 出した。そして、ディスク状記録媒体用基板の成形体中 に混入する所定径以上の異物粒子の数を制御することに より、所定の高さ以上の突起が存在しないディスク状記 録媒体用基板が製造されることを見出した。

【0020】現在の光を使用して記録及び/又は再生が 行われるディスク状記録媒体に対して広く使用されてい るレーザピームの波長入は、約659nmであることか ら、このディスク状記録媒体用の基板に約165nm (λ/4)以上の高さの突起が存在すると、上述したニ アフィールド記録を行う際に、この突起が、ディスク状 記録媒体と浮上型光学ヘッドとの衝突の原因となる。そ して、ディスク状記録媒体用基板の成形体中に、粒径 2. 0 μm以上の異物粒子が所定量以上存在すると、デ ィスク状記録媒体用基板の基板表面に、約165nm以 上の高さの突起が発生する可能性が著しく増大すること が判った。

【0021】本発明に係るディスク状記録媒体用基板の 製造方法は、以上のような知見に基づいて創案されたも のであって、光を使用して記録及び/又は再生が行われ るディスク状記録媒体に用いられるディスク状記録媒体 用基板を製造するに際し、樹脂を成形体中の粒径2.0 μm以上の粒子の数が10000個/g以下となるよう に制御してディスク状に成形し、少なくとも信号が記録 される領域には、基板表面から測定した高さが上記光の 【0016】また、本発明に係るディスク状記録媒体用 50 波長の1/4以上となる突起が形成されていないディス

ク状記録媒体用基板を製造するようにしている。

【0022】成形体中の異物粒子の数を制御する方法と しては、例えば異物粒子数の少ない樹脂を用い、且つ、 クリーン度の高い環境下で成形する方法が挙げられる。 【0023】このディスク状記録媒体用基板の製造方法 によれば、基板表面に、約165nm以上の突起が存在 しないディスク状記録媒体用基板を製造することができ る。

【0024】また、本発明に係るディスク装置は、ディ スク状記録媒体を回転駆動させるモータと、このモータ 10 により回転駆動されるディスク状記録媒体上を、使用す る光の波長の1/4以内の浮上量で浮上して、このディ スク状記録媒体に対して情報信号の書き込み又は読み出 しを行う浮上型光学ヘッドとを備え、上記ディスク状記 録媒体の少なくとも信号が記録される領域には、その表 面から測定した高さが、上記光の波長の1/4以上とな る突起が形成されていないことを特徴としている。

【0025】このディスク装置によれば、浮上型光学へ ッドが、モータにより回転駆動されるディスク状記録媒 体上を使用される光の波長の1/4以内の浮上量で浮上 20 して、このディスク状記録媒体に対して情報信号の書き 込み又は読み出しを行う。

【0026】このとき、ディスク状記録媒体の少なくと も信号が記録される領域には、その表面から測定した高 さが、使用する光の波長の1/4以上となる突起が形成 されていないので、浮上型光学ヘッドとディスク状記録 媒体との衝突が回避され、信頼性の高い記録及び/又は 再生を行うことができる。

[0027]

を参照して説明する。

【0028】本発明に係るディスク状記録媒体用基板 (以下、ディスク基板という。) は、再生専用光ディス ク、光磁気ディスク、相変化型光ディスク等のように、 光を使用して記録及び/又は再生が行われるディスク状 記録媒体に用いられる基板であって、少なくともディス ク状記録媒体の信号が記録される領域に対応した領域に は、基板表面から測定した高さが使用する光の波長の1 /4以上となる突起が形成されていないことを特徴とし ている。

【0029】そして、このディスク基板は、浮上型光学 ヘッドによって情報信号の読み出し又は書き込みが行わ れるディスク状記録媒体の基板として好適であり、特 に、ニアフィールド記録と呼ばれる、近接場の漏れ光を 利用して記録再生を行う方式により情報信号の読み出し 又は書き込みが行われるディスク状記録媒体の基板とし て好適である。

【0030】ニアフィールド記録は、屈折率nの高いレ ンズを有する浮上型光学ヘッドを、ディスク状記録媒体 の信号記録面から、使用する光の波長の1/4以内の高 50 塗布されることにより形成される。

さで浮上させて、ディスク状記録媒体の信号記録面上に スポット径が1/nに絞られたレーザビームを照射し、 ディスク状記録媒体から情報信号を読み出し、又はディ スク状記録媒体に情報信号を書き込む方式であり、スポ ット径を小さくすることにより、高密度記録を実現する ものである。

【0031】このディスク基板は、使用する光の波長の 1/4以上の高さの突起を持たないので、ニアフィール ド記録により情報信号の読み出しや書き込みを行うよう にしても、浮上型光学ヘッドとの衝突が回避され、信頼 性が向上する。

【0032】以下、このディスク基板を樹脂を用いて成 形し、光磁気記録層を有する光磁気ディスクの基板とし て用いて、浮上型光学ヘッドでニアフィールド記録によ りこの光磁気ディスクに対して記録及び再生を行うよう にした例について説明する。

【0033】光磁気ディスク10は、例えば図2に示す ように、ディスク基板11上に光磁気記録層12が形成 されている。

【0034】光磁気記録層12は、A1反射膜13と、 第1の誘電体膜14と、記録膜15と、第2の誘電体膜 16とが順次積層されてなる。

【0035】記録膜15は、光磁気効果を発揮する膜で あり、その材料としては、例えば、希土類としてTb、 遷移金属としてFeを用いたTb-Feアモルファス系 の材料等が用いられる。

【0036】A1反射膜13は、記録膜15の反射率を 向上させるためのものである。

【0037】また、第1及び第2の誘電体膜14,16 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 30 は、記録膜15の耐湿性の向上やディスク基板11の熱 変形を防止を図るとともに、記録膜15による光の吸収 を増大させ且つ反射率変化を大きくするといった光学的 な効率の向上を図るためのものであり、その材料として は、例えば、ZnS-SiO₂系の材料等が用いられ る。

> 【0038】光磁気ディスク10は、ディスク基板11 上に、上述した光磁気記録層12を構成する各膜が、例 えばスパッタリング等により成膜されることにより製造 される。

40 【00·39】なお、光磁気ディスク10は、光磁気記録 層12上に、光磁気記録層12を保護するための保護層 17や、浮上型光学ヘッドが光磁気ディスク10に接触 した際の衝撃を緩和するための、図示しない潤滑剤層が 形成されていることが望ましい。

【0040】保護層17は、例えばカーボンやSiO 等がスパッタリング等により光磁気記録層12上に成膜 されることにより形成される。

【0041】また、潤滑剤層は、例えばパーフルオロボ リエーテル等がスピンコート法等により保護層17上に

【0042】一方、浮上型光学ヘッド20は、図3に示すように、半導体レーザから出射されるレーザビームを集光するブリフォーカスレンズ21と、このブリフォーカスレンズ21により集光されたレーザビームをさらに絞り込んでピームスボットを形成するフォーカスレンズ22との2種類のレンズを備え、これらがレンズホルダ23に支持されてなる。

【0043】2種類のレンズのうち、フォーカスレンズ22は、屈折率の高い材料が例えば半球状に成形されてなり、円形平面が光磁気ディスク10の光磁気記録層12側の面と対向するように、レンズホルダ23に支持されている。

【0044】また、この浮上型ヘッド20には、磁界変調用の薄膜コイル24が、フォーカスレンズ22の外周側に位置して、レンズホルダ23に支持された状態で設けられている。

【0045】以上のように構成される浮上型光学ヘッド20は、回転する光磁気ディスク10上を浮上しながら、半導体レーザから出射されたレーザビームを集光して光磁気ディスク10の光磁気記録層12に照射させる。また、この浮上型光学ヘッド20は、記録時においては、薄膜コイル24が所定の強度の磁界を発生して、この磁界を光磁気記録層12のレーザビームが照射された箇所に印加する。

【0046】このような構成の浮上型光学ヘッド20を用いた場合、ニアフィールド記録により、光磁気ディスク10に対して情報信号の記録及び再生を行うことができる。すなわち、半導体レーザから出射されプリフォーカスレンズ21により集光されたレーザビームを、屈折率の高い材料からなるフォーカスレンズ22を透過させ 30 てさらに絞り込むことにより、フォーカスレンズ22からの距離がレーザビームの波長の1/4以内の領域においては、レーザビームのスポット径を小さくすることが可能である

【0047】対物レンズがディスクからある程度離れた位置に配置される光学系を用いて波長がλのレーザビームを集光した場合、レーザビームのスポット径は、λ/NA(NAは光学系の開口数)となるが、浮上型光学へッド20を用いて波長が入のレーザビームを集光した場合、フォーカスレンズ22からの距離がレーザビームの40波長入の1/4以内の領域においては、径が1/n×λ/NA(nはフォーカスレンズ22の屈折率、NAは浮上型光学へッド20の開口数)と絞られたレーザビームのスポットを得ることができる。

【0048】したがって、この浮上型光学ヘッド20を、光磁気ディスク10の光磁気記録層12から入/4以内の浮上量で浮上させて、光磁気ディスク10に対して記録及び再生を行うことにより、対物レンズがディスクからある程度離れた位置に配置される光学系を用いた場合に比べて光磁気ディスク10の記録容量をn倍程度

にまで向上させることができる。

[0049]ところで、このように浮上型光学ヘッド20を光磁気ディスク10の光磁気記録層12から $\lambda/4$ 以内の浮上量で浮上させて、ニアフィールド記録により記録及び再生を行う場合、光磁気ディスク10の信号記録領域に $\lambda/4$ を越える突起が形成されていると、この突起に浮上型光学ヘッド20が衝突してしまい、光磁気ディスク10あるいは浮上型光学ヘッド20の損傷を招いてしまうことになる。

【0050】そこで、ディスク基板11は、少なくとも 光磁気ディスク10の信号が記録される領域に対応した 領域に、その基板表面から測定した高さが、使用される 光の波長の1/4以上となる突起が形成されないように している。

【0051】ここで、本発明に係るディスク基板11の 製造方法について説明する。このディスク基板11は、 例えば樹脂材料が例えば射出成形されることにより製造 される。

【0052】このディスク基板11の材料として使用す 20 る樹脂材料としては、耐熱性、精密成形性、低吸湿変形 性、高弾性率等に優れた熱可塑性樹脂が好ましい。

【0053】さらに詳しくは、耐熱性の観点から、ガラス転移温度が50 \mathbb{C} 以上、好ましくは70 \mathbb{C} 以上、より好ましくは100 \mathbb{C} 以上、精密成形性の観点から、非晶性樹脂でガラス転移温度が300 \mathbb{C} 以下、好ましくは250 \mathbb{C} 以下、より好ましくは200 \mathbb{C} 以下、低吸湿性の観点から、吸水率(25 \mathbb{C} 、24 時間浸漬後)が0.2 %以下、好ましくは0.1 %以下の非晶質熱可塑性樹脂が好ましい。

【0054】より具体的には、例えば、ポリカーボネー ト樹脂、例えばボリ(オキシカルボニル-1, 4-フェ ニレンイソプロピリデン-1,4-フェニレン);ポリ アリレート樹脂、例えばポリ((オキシーテレフタロイ ルオキシー1, 4-フェニレンイソプロピリデンー1, 4-フェニレン) - コー (オキシーイソフタロイルオキ シー1, 4-フェニレンイソプロピリデン-1, 4-フ エニレン))、テレフタル酸・イソフタル酸・ピスフェ ノールA重縮合物等;ポリサルホン樹脂、例えばポリ (オキシ-1, 4-フェニレンスルホニル-1, 4-フ ェニレンオキシー1,4-フェニレンイソプロピリデン -1, 4-フェニレン);ボリエーテルスルホン樹脂、 例えばボリ(オキシー1, 4-フェニレンスルホニルー 1, 4-フェニレン);ポリエーテルイミド樹脂、例え ば4, 4′- 〔イソプロピリデンビス(p-フェニレン オキシ)〕ジフタル酸二無水物・m-フェニレンジアミ ン重縮合物等の分子内に極性基を有する樹脂を挙げるこ とができる。これらの極性基を有する樹脂の中では、高 弾性率の点からポリエーテルイミド樹脂が好ましい。

クからある程度離れた位置に配置される光学系を用いた 【0055】また、これらの極性基を有する樹脂に加え場合に比べて光磁気ディスク10の記録容量をn倍程度 50 てポリスチレン樹脂等の非極性の芳香族基含有樹脂、及

びその水素添加物;シクロジエン系樹脂、例えば特開平 6-136057号公報、特開平7-258362号公 報等に開示されているシクロペンタジエン重合体水素化 物、シクロヘキサジエン重合体水素化物等;熱可塑性ノ ルボルネン系樹脂、例えば特開昭51-80400号公 報、特開昭60-26024号公報、特開平1-168 725号公報、特開平1-190726号公報、特開平 3-14882号公報、特開平3-122137号公 報、特開平4-63807号公報等にて開示されている ノルボルネン系モノマーの開環重合体、ノルボルネン系 10 モノマーの開環重合体水素添加物、ノルボルネン系モノ マーの付加重合体、ノルボルネン系モノマーとオレフィ ンの付加共重合体;等の分子内に炭化水素環をもつ樹脂 を挙げることができる。

【0056】これらの極性又は非極性の樹脂のなかで も、耐熱性、低吸水性の点で分子内に炭素環をもつ樹脂 が好ましく、そのなかでもノルボルネン系モノマーの開 環重合体水素添加物、シクロペンタジエン重合体水素化 物、シクロヘキサジエン重合体水素化物、ノルボルネン 系モノマーの付加重合体、ノルボルネン系モノマーとオ 20 レフィンの付加共重合体、ポリスチレン樹脂の水素添加 物等の分子内に不飽和結合を有さないものがディスクの 屈折率を小さくし、また耐久性に優れる点で特に好まし い。また、高弾性率の観点からは、シクロヘキサジエン 重合体水素化物等が特に好ましい。

【0057】耐熱性、精密成形性、低吸水性等のバラン スの良い点では、熱可塑性ノルボルネン系樹脂が最も好 ましい。

【0058】熱可塑性ノルボルネン系樹脂を得るための 公報、特開平2-276842号公報等で公知のノルボ ルネン系単量体を用いれば良い。このようなノルボルネ ン系単量体としては、例えば、ノルボルネン、そのアル キル、アルキリデン、アルケニル、芳香族置換誘導体及 びこれら置換又は非置換のオレフィンのハロゲン、水酸 基、エステル基、アルコキシ基、シアノ基、アミド基、 イミド基、シリル基などの極性基置換体がある。具体例 としては、2-ノルボルネン、5-メチル-2-ノルボ ルネン、5,5-ジメチル-2-ノルボルネン、5-エ チルー2-ノルボルネン、5-ブチル-2-ノルボルネ 40 ン、5-ヘキシル-2-ノルボルネン、5-オクチル-2-ノルボルネン、5-オクタデシル-2-ノルボルネ ン、5-エチリデン-2-ノルボルネン、5-イソプロ ペニルー2-ノルボルネン、5-メトキシカルボニルー 2-ノルボルネン、5-シアノ-2-ノルボルネン、5 -メチル-5-メトキシカルボニル-2-ノルボルネ ン、5-フェニル-2-ノルボルネン、5-フェニル-5-メチルーノルボルネン等が挙げられる。

【0059】また、ノルボルネンに一つ以上のシクロペ ンタジエンが付加した単量体、その上記と同様の誘導体 50 られる。

や置換体でもよい。具体例として、1,4:5,8-ジ $\forall 9/-1, 4, : 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-47$ タヒドロナフタレン、6-メチル-1、4:5、8-ジ メタノー1, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 8 a - オクタ ヒドロナフタレン、6-エチル-1,4:5,8-ジメ タノ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒ ドロナフタレン、6-エチリデン-1,4:5,8-ジ メタノー1, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 8 a - オクタ ヒドロナフタレン、6-メチル-6-メトキシカルボニ $\mathcal{W}-1$, 4:5, 8- \mathcal{Y} \mathcal{Y} \mathcal{Y} \mathcal{Y} -1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン、6 - シア J-1, 4:5, 8-ジメタノ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン等が挙げら れる。

【0060】さらに、シクロペンタジエンの多量体であ る多環構造の単量体、その上記と同様の誘導体や置換体 であっても良い。具体例として、ジシクロペンタジエ 2, 1, 4:5, 8-2222, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a - 2, 3 - シクロペンタジエノナ フタレン、1,4:5,10:6,9-トリメタノー 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 5 a, 6, 9, 9 a, 1 0,10a-ドデカヒドロ-2、3-シクロペンタジエ ノアントラセン、2、3-ジヒドロジシクロペンタジエ ン等が挙げられる。

【0061】また、シクロペンタジエンとテトラヒドロ インデン、インデン、ベンゾフラン等とその付加物、そ の上記と同様の誘導体や置換体であっても良い。具体例 として、1, 4-メタノ-1, 4, 4a, 4b, 5, 8,8a,9a-オクタヒドロフルオレン、5,8-メ 単量体としては、上記公報や、特開平2-27424号 30 タノ-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒ ドロー2、3-シクロペンタジエノナフタレン、1,4 -メタノ-1, 4, 4a, 9a-テトラヒドロフルオレ ン、1、4-メタノ-1、4、4a、9a-テトラヒド ロジベンゾフラン等;などが挙げられる。

> 【0062】本発明に用いる熱可塑性ノルボルネン系樹 脂は、例えば上記ノルボルネン系単量体の中から選んだ 少なくとも一種以上の単量体を含有するものを公知の方 法により開環重合したもの及びこれを公知の方法により 水素添加したものである。例えば、目的とする重合体の 溶解性などの特性を実質的に損なわない、また改善する 範囲で上記単量体以外にこれらと共重合可能な単量体を 共重合していても良い。共重合可能な単量体としては、 シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シ クロオクテン等のシクロオレフィンが挙げられる。

> 【0063】また、熱可塑性ノルボルネン系樹脂は、上 記のノルボルネン系単量体とオレフィンの付加共重合体 であっても良い。この場合、オレフィンとしてエチレ ン、プロピレン、1ーブテン、1-ヘキセン、4-メチ ルー1-ペンテン、スチレン等の α -オレフィンが用い

40

【0064】 これら熱可塑性のノルボルネン系樹脂の、25℃のデカリンもしくはトルエン中で測定した極限粘度 [η] は、0.01~20d1/g、好ましくは0.05~10d1/g、より好ましくは0.1~5d1/gである。極限粘度が小さすぎると重合体としての形状

【0065】また、これら熱可塑性ノルボルネン系樹脂のガラス転移温度(以下、Tgとする。)は、50 $^{\circ}$ ~200 $^{\circ}$ 、好ましくは70 $^{\circ}$ ~180 $^{\circ}$ 、より好ましくは80 $^{\circ}$ ~160 $^{\circ}$ である。

を保たなくなり、大きすぎると成形性が悪くなる。

【0066】なお、上記熱可塑性ノルボルネン系樹脂には、所望により、フェノール系やリン系等の酸化防止剤、ベンゾフェノン系等の紫外線吸収剤、耐光安定剤、帯電防止剤、脂肪族アルコールのエステル、多価アルコールの部分エステルおよび部分エーテル等の滑剤、等の各種添加剤を添加しても良い。また、本発明の目的を損なわない範囲で、他の樹脂、ゴム質重合体等を混合して用いることもできる。

【0067】本発明に使用される粒径2.0 μ m以上の異物粒子数が10000個/g以下である樹脂ペレット 20を製造するには、例えば合成された樹脂を溶媒に溶解した溶液を、口径1~5 μ m程度の口径の大きいフィルターから、順次、口径0.2 μ m程度の口径の小さいフィルターを使用して多段階で濾過したり、それらと組み合わせるか、または単独でゼータ電位による吸着能を有するフィルターにより濾過した後、外部環境から異物が混入しないように密閉系で樹脂溶液を減圧下に加熱して揮発成分の除去を行い、例えばクリーンルーム内等のクリーン度の高い環境(クリーン度をクラス1000程度以下、好ましくはクラス100程度以下に厳重に管理した 30環境)で冷却・ペレット化する方法等により行うことができる。

【0068】この異物粒子数を制御した樹脂ペレットを用いてディスク基板11を射出成形する場合、ここでも例えばクリーンルーム内等のクリーン度の高い環境(クリーン度をクラス100程度以下、好ましくはクラス100程度以下に厳重に管理した環境)で射出成形を行うことにより、樹脂成形体中の粒径2.0μm以上の異物粒子数を成形用樹脂と同程度の10000個/g以下に保つことができる。

【0069】このように樹脂成形体中の粒径 2.0μ m以上の異物粒子数を10000個/g以下に制御することにより、ディスク基板110基板表面に約165nm(使用するレーザビームの波長が659nmである場合に、波長の1/4となる値)以上の高さの突起が発生する可能性を著しく減少させることができる。

【0070】なお、樹脂成形体中の異物粒子数は、少なければ少ないほどディスク基板11の基板表面に形成される突起の数を少なくしてディスク基板11の成形部留まりを向上させることができ、樹脂成形体中の粒径2.

0μm以上の異物粒子数は、2000個/g以下となるように制御することが更に好ましく、500個/g以下となるように制御すれば特に好ましい。

【0071】また、ディスク基板11の基板表面に約165 n m以上の突起が形成されないようにするという観点からは、樹脂成形体中の粒径 2.0μ m以下の異物粒子数は特に制御する必要はないが、光磁気ディスク10 に記録される信号の信頼性を向上させ、また光磁気ディスク10 の耐久性を向上させるという観点からは、粒径 2.0μ m以下の異物粒子数も制御することが好ましい。

【0072】例えば、樹脂成形体中の粒 21.0μ m以上 2.0μ m未満の異物粒子数は、50000個/g以下となるように制御することが好ましく、10000個/g以下となるように制御すれば更に好ましく、20000個/g以下となるように制御すれば特に好ましい。

【0073】また、樹脂成形体中の粒径0.5μm以上

1. 0μ m未満の異物粒子数は、100000個/g以下となるように制御することが好ましく、40000個/g以下となるように制御すれば更に好ましく、10000個/g以下となるように制御すれば特に好ましい。 【0074】ディスク基板11は、以上説明した樹脂材料が射出成形されることにより、例えば、ディスク表面に光学へッド位置決め情報やアドレス情報等が記録された光磁気ディスク10用の基板として、基板表面に凹部を有するディスク基板11として製造される。ここで、基板表面とは、凹部に対して凸となる部分の上面をいい、この基板表面上に情報信号が記録されることになる。このディスク基板110凹部の基板表面からの深さは、 $0.05\sim0.3\mu$ m程度に設定される。

【0075】なお、このディスク基板11を射出成形により製造する際は、無電解メッキ法によりディスク基板11の凹部と反転したパターンの凸部が形成されたスタンパー等が使用される。このスタンパーの凸部面のみ、あるいはスタンパー表面の表面粗度は、それぞれRa値で通常2.0nm以下、好ましくは1.0nm以下とされている。

【0076】ディスク基板11は以上のように製造されることにより、少なくとも光磁気ディスク10の信号記録領域となる領域には、その基板表面から測定した高さが、使用される光の波長の1/4以上となる突起が形成されていない平面が得られる。

【0077】そして、光磁気ディスク10は、このディスク基板11上に光磁気記録層12が形成されて製造されることにより、少なくとも信号記録領域を、使用される光の波長の1/4以上となる突起のない平滑な面とすることができ、浮上型光学ヘッド20でニアフィールド記録により記録再生を行う際に、浮上型光学ヘッド20と衝突するという不都合が回避され、信頼性が向上す

る。

【0078】なお、ディスク基板11は、上述した製造 例の中から最適な例を適用して、少なくとも光磁気ディ スク10の信号記録領域となる領域には、その基板表面 から測定した高さが、使用される光の波長の1/6以上 となる突起が形成されないようにすることがより好まし 610

【0079】このように、光磁気ディスク10の信号記 録領域を、使用される光の波長の1/6以上となる突起 のない、より平滑な面とすることにより、浮上型光学へ 10 スコイルモータ42とを備えている。 ッド20でニアフィールド記録により記録再生を行う際 に、ディスク状記録媒体10と浮上型光学ヘッド20間 にぶれが生じても、光磁気ディスク10と浮上型光学へ ッド20との衝突が回避され、光磁気ディスク10の信 頼性がさらに向上する。

【0080】また、ディスク基板11は、その光磁気デ ィスク10の信号記録領域となる領域に、突起のみでな く凹状部もなるべく形成されていないことが望ましい。 【0081】なお、以上は、本発明を光磁気記録層12 を有する光磁気ディスク10用のディスク基板11に適 20 用した例について説明したが、本発明はこの例に限定さ れるものではなく、再生専用の光ディスク用のディスク 基板や相変化型の光ディスク用のディスク基板に適用す ることもできる。

【0082】以上のようなディスク基板11を用いた光 磁気ディスク10は、例えば図4及び図5に示すような ディスク装置30に装着されて記録及び再生が行われ る。なお、図4は、このディスク装置30の概略構成を 示すブロック図であり、図5は、このディスク装置30 の要部の縦断面図である。

【0083】このディスク装置30は、光磁気ディスク 10を回転駆動させるスピンドルモータ31と、このス ピンドルモータ31により回転駆動される光磁気ディス ク10に対して情報信号の書き込み又は読み出しを行う ヘッド機構32と、ヘッド機構32から供給された受光 信号に基づいてMO再生信号及び制御信号を生成する信 号処理部33と、スピンドルモータ31及びヘッド機構 32の動作を制御するシステムコントローラ34とを備

【0084】スピンドルモータ31は、システムコント 40 ローラ34の制御により、保持した光磁気ディスク10 を所定の速度で回転駆動させる。

【0085】ヘッド機構32は、図5に示すように、浮 上型光学ヘッド20と、この浮上型光学ヘッド20を駆 動させるヘッド駆動部40と、光磁気ディスク10に向 けてレーザビームを出射するとともに光磁気ディスク1 0にて反射されたレーザビーム (戻り光) を受光する発 光/受光部44とを備えている。

【0086】浮上型光学ヘッド20は、先に図3で示し

ズ22とがレンズホルダ23に支持されてなり、フォー カスレンズ22の外周側には磁界変調用の薄膜コイル2 4が設けられている。なお、この浮上型光学ヘッド20 の詳細は上述した通りであるので、ここでは説明を省略 する。

【0087】ヘッド駆動部40は、回動軸43に回動可 能に取り付けられてその一端側にて浮上型光学ヘッド2 0を支持する支持アーム41と、この支持アーム41の 他端側に設けられこの支持アーム41を回動させるボイ

【0088】このヘッド駆動部40は、システムコント ローラ34の制御により、ボイスコイルモータ42に所 定の電流が供給されると、ボイスコイルモータ42が支 持アーム41を回動軸43を回動中心として回動させ、 支持アーム 4 1 の一端側に取り付けられた浮上型光学へ ッド20を、回転する光磁気ディスク10の光磁気記録 層12から所定量浮上させた状態で、光磁気ディスク1 0の径方向に移動させる。

【0089】発光/受光部44は、図示を省略するが、 光磁気ディスク10の光磁気記録層12に向けて所定の 波長のレーザビームを出射する半導体レーザと、光磁気 ディスク10の光磁気記録層12からの戻り光を受光 し、受光した光を電気信号(受光信号)に変換してこの 受光信号を信号処理部33に供給するフォトディテクタ とを備えている。また、半導体レーザから出射され光磁 気ディスク10の光磁気記録層12で反射されてフォト ディテクタで受光されるレーザビームの光路上には、図 5に示すようなレーザピームを反射させて光路を折り曲 げるミラー45、46や、図示を省略するが、レーザビ 30 ームを分離するピームスプリッタ等の光学素子が配置さ れている。

【0090】信号処理部33は、ヘッド機構32の発光 /受光部44のフォトディテクタから供給される受光信 号に基づいて、MO再生信号を生成してこのMO再生信 号を出力するとともに、トラッキングエラー信号等の制 御信号を生成してこの制御信号をシステムコントローラ 34に供給する。

【0091】システムコントローラ34は、スピンドル モータ31の動作を制御して光磁気ディスク10を所定 の速度で回転させる。また、システムコントローラ34 は、図示しない装置から供給される記録信号に基づいて ヘッド機構32に記録動作を行わせるとともに、ヘッド 機構32に再生動作を行わせる。このとき、システムコ ントローラ34は、信号処理部33から供給される制御 信号に基づいてヘッド機構32にトラッキング制御を行 わせる。

【0092】以上のように構成されるディスク装置30 は、記録時においては、システムコントローラ34の制 御により、スピンドルモータ31が、装着された光磁気 たように、プリフォーカスレンズ21とフォーカスレン 50 ディスク10を所定の速度で回転させる。また、発光/

受光部44の半導体レーザが、例えば波長が659nm の赤色レーザビームを出射する。

【0093】半導体レーザから出射されたレーザビーム は、ミラー45、46により曲折され、浮上型光学ヘッ ド20に入射される。

【0094】浮上型光学ヘッド20は、ヘッド駆動部4 0の支持アーム41に支持されて、回転する光磁気ディ スク10上を、例えば光磁気記録層12から165nm 以内の浮上量で浮上した状態で、入射したレーザピーム を収束して光磁気ディスク10の光磁気記録層12に照・10 射させる。このとき、光磁気ディスク10の表面には、 高さが165nm以上の突起が形成されていないので、 浮上型光学ヘッド20が光磁気ディスク10の突起に衝 突する不都合が回避される。

【0095】また、浮上型ヘッド20は、システムコン トローラ34の制御により、薄膜ヘッド24が記録信号 に対応した強度の磁界を発生し、この磁界を光磁気記録 層12のレーザビームが照射された箇所に印加する。

【0096】以上のようにして、ディスク装置30は、 光磁気ディスク10の光磁気記録層12に所定の情報信 20 号を記録する。なお、この記録時においても、後述する 再生時と同様にトラッキング制御が行われる。

【0097】ディスク装置30は、再生時においては、 システムコントローラ34の制御により、スピンドルモ 一夕31が、装着された光磁気ディスク10を所定の速 度で回転させる。また、発光/受光部44の半導体レー ザが、例えば波長が659nmの赤色レーザピームを出 射する。

【0098】半導体レーザから出射されたレーザビーム は、ミラー45,46にて反射され、浮上型光学ヘッド 30 20に入射される。

【0099】浮上型光学ヘッド20は、ヘッド駆動部4 0の支持アーム41に支持されて、回転する光磁気ディ スク10上を、例えば光磁気記録層12から165nm 以内の浮上量で浮上した状態で、入射したレーザビーム を収束して光磁気ディスク10の光磁気記録層12に照 射させる。このとき、光磁気ディスク10の表面には、 高さが165nm以上の突起が形成されていないので、 浮上型光学ヘッド20が光磁気ディスク10の突起に衝 突する不都合が回避される。

【0100】光磁気ディスク10の光磁気記録層12に 照射されたレーザビームは、この光磁気記録層12で反 射され、信号成分を含んだ戻り光となる。そして、この 戻り光は、浮上型光学ヘッド20を透過し、ミラー4 5,46にて反射されて、発光/受光部44のフォトデ ィテクタにより受光される。

【0101】フォトディテクタは、受光した戻り光を電 気信号(受光信号)に変換して、信号処理部33に供給 する。

【0 1 0 2】信号処理部33は、フォトディテクタから 50 製) 5部を加え、水素により50kg/cm'に加圧し

供給された受光信号に基づいてMO再生信号を生成して 出力するとともに、フォトディテクタから供給された受 光信号に基づいてトラッキングエラー信号等の制御信号 を生成し、この制御信号をシステムコントローラ34に 供給する。

【0103】システムコントローラ34は、信号処理部 33より供給された制御信号に基づいてヘッド駆動部4 0のボイスコイルモータ43を制御して、支持アーム4 1に支持された浮上型光学ヘッド20を光磁気ディスク 10の径方向に移動させ、トラッキング制御を行う。

【0104】以上のようにして、ディスク装置30は、 光磁気ディスク10に記録された情報信号を適切に再生 する。

【0105】このディスク装置30は、浮上型光学ヘッ ド20が、光磁気ディスク10の光磁気記録層12から の離間距離がレーザビームの波長の1/4以内の範囲で 浮上しながら、光磁気ディスク10の光磁気記録層12 にレーザビームを照射するようにしているので、レーザ ビームのスポット径を小さくすることができ、光磁気デ ィスク10に対して高密度で情報信号を記録し、また は、高密度で情報信号が記録された光磁気ディスク10 の情報信号を再生することができる。

【0106】また、このディスク装置30は、基板表面 にレーザビームの波長の1/4以上の高さを有する突起 が形成されていないディスク基板11を用いた光磁気デ ィスク10に対して情報信号の記録及び再生を行うよう にしているので、浮上型光学ヘッド20が光磁気ディス ク10の表面の突起に衝突して、浮上型光学ヘッド20 あるいは光磁気ディスク10の損傷を招いてしまうとい う不都合が回避され、信頼性の高い記録及び再生動作を 行うことができる。

【0107】なお、以上は、光磁気ディスク10に対し て記録及び再生を行うディスク装置30を例に説明した が、本発明は、この例に限定されるものではなく、再生 専用の光ディスクに対して再生を行うディスク装置や、 相変化型の光ディスクに対して記録及び再生を行うディ スク装置にも適用することができる。

[0108]

【実施例】以下、本発明について、実施例及び比較例を 40 挙げて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に のみ限定されるものではない。なお、以下の説明におい て、特に断りのない限り、部及び%は重量基準である。

【0109】樹脂調製例1

6-メチル-1, 4:5, 8-ジメタノ-1, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン (以下、MTDという) 90%と5-メチルー2-ノル ボルネン10%を含んでなるモノマーから合成した開環 重合体100部をシクロヘキサン400部に溶解し、水 素化触媒としてニッケル一アルミナ触媒(日揮化学社

て、撹拌しながら温度200℃まで加温した後、4時間 反応させ、開環重合体水素化ポリマーを合成した。

【0110】不均一の水素化触媒を含んだボリマー含量20%の反応液をラジオライト#500を濾過床として、加圧濾過(フンダフィルター、石川島播磨重工社製)を使用し、圧力2.5kg/cm²で加圧濾過(一段目の濾過工程)して、無色透明な溶液(溶液1-5)を得た。

【0111】溶液1-5、100部を、更に金属ファイバー製フィルター(口径 3μ m、ニチダイ社製)にて濾 10 過(二段目の濾過工程)し、更に金属ファイバー製フィルター(口径 0.2μ m、ニチダイ社製)にて濾過(三段目の濾過工程)して異物を除去し、溶液1-6を得た。

【0112】溶液1-6を用いて、溶剤成分であるシク ロヘキサンを円筒形濃縮乾燥器(日立製作所製)によっ て、運転条件を第1ステップ:温度270℃、圧力10 OTorr、第2ステップ:温度270℃、圧力5To rrとして除去(乾燥工程)した。クラス1000のク リーンルーム内で、溶融状態のポリマーをダイから押し 出し、水冷した後、ペレタイザー(OSP-2、長田製 作所製)でカッティングし、ペレット18部(ポリマー A)を得た。ポリマーAは表面を研磨したステンレス製 密閉容器に充填し、保管した。ポリマーA10%のトル エン溶液をガスクロマトグラフィーで分析した結果、残 留シクロヘキサン量は測定限界以下であった。ポリマー Aは、無色透明で、GPC分析によるボリスチレン換算 分子量はMn:27,000、Mw:56,000、D SC分析により測定したTgは140℃であった。更 に、重クロロホルム溶液として、「H-NMRスペクト 30 ルにより測定した水素添加率はほぼ100%であった。 ポリマーAを0. $2 \mu m$ カートリッジフィルターにて濾 過精製したトルエンを用いて1.5%濃度の溶液とし、 光散乱式微粒子検出器(KS-58、リオン社製)を用 いて粒径2.0μm以上の異物個数を測定した結果、6 0個/gであった。

【0113】樹脂調製例2

【0114】樹脂調製例3

6-メチル-6-メトキシカルボニル-1, 4:5, 8 -ジメタノ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オ 50 クタヒドロナフタレン80%と5-メチル-5-メトキシカルボニル-2-ノルボルネン20%を含んでなるモノマーから合成した開環重合体100部をシクロヘキサン/テトラヒドロフラン(以下、THFという。)1:1混合溶剤400部に溶解し、水素化触媒としてニッケル-アルミナ触媒(日揮化学社製)5部を加え、水素により50kg/cm²に加圧して、撹拌しながら温度200℃まで加温した後、4時間反応させ、開環重合体水素化ポリマーを合成した。

【0115】不均一の水素化触媒を含んだポリマー含量20%の反応液をラジオライト#500を濾過床として、加圧濾過(フンダフィルター、石川島播磨重工社製)を使用し、圧力2.5kg/cm²で加圧濾過して、無色透明な溶液(溶液2-5)を得た。

【0116】溶液2-5、100部を、更にに金属ファイパー製フィルター(口径3 μ m、ニチダイ社製)及び 金属ファイパー製フィルター(口径0.2 μ m、ニチダイ社製)にて濾過して異物を除去し、溶液2-6を得た。

【0117】溶液1-6に代えて溶液2-6を用いる以外は樹脂調製例1と同様にして、溶剤を除去し、ペレット17部(ポリマーC)を得た。ポリマーCは樹脂調製例1と同様に表面を研磨したステンレス製密閉容器に充填し、保管した。樹脂調製例1と同様にして分析した結果、残留シクロヘキサン量は測定限界以下、分子量はMn:17,500、Mw:56,000、Tgは139℃、粒径2.0μm以上の異物個数は90個/gであった。

【0118】樹脂調製例4

30 上記二段目の濾過工程と三段目の濾過工程を行わず、溶液1-6に代えて溶液2-5をそのまま乾燥する以外は樹脂調製例1と同様にして、溶剤を除去し、ペレット17部(ボリマーD)を得た。ボリマーDは樹脂調製例1と同様に表面を研磨したステンレス製密閉容器に充填し、保管した。樹脂調製例1と同様にして分析した結果、残留シクロヘキサン量は測定限界以下、分子量はMn:27,000、Mw:56,000、Tgは140℃、粒径2.0μm以上の異物個数は19,000個/gであった。

0 【01.19】樹脂調製例5

三菱ガス化学製ディスク用ポリカーボネート(商品名; Iupiron H-4000)をパット式送風乾燥機を用いて100 \mathbb{C} ×10hrの条件で乾燥し、ポリマー Eを得た。ポリマーEは樹脂調製例1と同様に表面を研磨したステンレス製密閉容器に充填し、保管した。光散 乱式微粒子検出器(KS-58、リオン社製)を用いて、溶媒をトルエンに代えて塩化メチレンを使用する以外は樹脂調製例1と同様にして分析した結果、粒径2.0 μ m以上の異物個数は1,400個/gであった。 [0120] 樹脂調製例6

三井石油化学製環状オレフィンコポリマー(商品名;A PL6015) 100部をシクロヘキサン400部に溶 解し、無色透明な溶液(溶液3-5)を得た。溶液3-5 を、更に金属ファイバー製フィルター(口径 3 μm、 ニチダイ社製) 及び金属ファイバー製フィルター(口径 0. 2μm、ニチダイ社製)にて濾過して異物を除去 し、溶液3-6を得た。

【0121】溶液1-6に代えて溶液3-6、100部 を用いる以外は樹脂調製例1と同様にして、溶剤を除去 し、ペレット18部(ポリマーF)を得た。ポリマーF は、前述同様にステンレス製密閉容器内に保管した。ボ リマーFは無色透明で、樹脂調製例1と同様に分析した 結果、残留シクロヘキサン量は測定限界以下、分子量は Mn: 47, 000, Mw: 83, 000, Tgは、1 37℃、粒径2.0μ以上の異物個数は110個/gで あった。

【0122】実施例1

樹脂調製例1で得られたポリマーAを用い、クリーン度 クラス1000クリーンルーム内に設置され、更にクリ ーンプースで金型部分をクリーン度クラス100の環境 20 に保持した射出成形機 (DISK3、住友重機械工業社 製)により、樹脂温度320℃、金型温度120℃で、 金型内に平滑な表面(Ra:1nm)を有するNi製ス タンパーを装填して直径65mm、厚さ1.2mmのデ ィスク基板を成形した。

【0123】得られた平滑なディスク基板20枚につ き、表面粗度(算術平均粗さ)Ra及び高さ165nm (使用するレーザビームの波長が659nmである場合 に、波長の1/4の値となる高さ)以上の突起の有無を 調べた。表面粗度は、ディスク基板の表面の50 μm× 30 50μmを触針でスキャンし、浮上型光学ヘッドの浮上 量と同等以上の突起のない領域を20μm×20μm切 り出してその領域での算術平均粗さRaで求めており、 あくまでも突起以外の表面の粗さを表現している。

【0124】表面粗度Raは、1.0~1.1nmで、 ほぼスタンパーの表面粗度に近かった。また、突起のな いディスク基板が20枚中19枚得られた。突起の有無 は、浮上量165nmで浮上型光学ヘッドが浮上するよ うにディスク回転数を制御し、浮上型光学ヘッドに取り 付けられたピエゾ素子で衝突時の加速信号から検出す る。この内の2枚のディスク基板から、各1.5gを切 り取り、樹脂調製例1と同様にトルエン溶液にして、粒 径2.0μm以上の異物個数を測定したところ、65個 /g及び67個/gであった。

【0125】実施例2

樹脂調製例3で得られたポリマーCを用い、実施例1と 同様にしてディスク基板を成形した。実施例1と同様 に、得られた平滑なディスク基板20枚につき、表面粗 度Ra及び高さ50nm以上の突起の有無を調べた結 果、表面粗度 $Raは、1.0\sim1.1$ nmで、ほぼスタ 50 様にして、粒径 2.0μ m以上の異物個数を測定したと

ンパーの表面粗度に近かった。また、突起のないディス ク基板は20枚中18枚得られた。この内の2枚のディ スク基板から、実施例1と同様にして、粒径2.0 um 以上の異物個数を測定したところ、95個/g及び11 0個/gであった。

【0126】実施例3

樹脂調製例5で得られたポリマーEを用い、実施例1と 同様にしてディスク基板を成形した。実施例1と同様 に、得られた平滑なディスク基板20枚につき、表面粗 度Ra及び高さ50nm以上の突起の有無を調べた結 果、表面粗度Raは、1.0~1.1nmで、ほぼスタ ンパーの表面粗度に近かった。また、突起のないディス ク基板は20枚中8枚得られた。この内の2枚のディス ク基板から、各1.5gを切り取り、樹脂調製例5と同 様にして、粒径2.0μm以上の異物個数を測定したと ころ、いずれも1,400個/gであった。

【0127】実施例4

樹脂調製例6で得られたポリマーFを用い、実施例1と 同様にしてディスク基板を成形した。実施例1と同様 に、得られた平滑なディスク基板20枚につき、表面粗 度Ra及び高さ50nm以上の突起の有無を調べた結 果、表面粗度Raは、1.0~1.1nmで、ほぼスタ ンパーの表面粗度に近かった。また、突起のないディス ク基板は20枚中17枚得られた。この内の2枚のディ スク基板から、各1.5gを切り取り、樹脂調製例1と 同様にして、粒径2. 0μm以上の異物個数を測定した ところ、120個/g及び130個/gであった。

【0128】実施例5·

樹脂調製例1で得られたポリマーAと樹脂調製例2で得 られたボリマーBを成形直前にポリマーAを25部に対 してポリマーBを75部プレンドし、実施例1と同様に してディスク基板を成形した。実施例1と同様に、得ら れた平滑なディスク基板20枚につき、表面粗度Ra及 び高さ50nm以上の突起の有無を調べた結果、表面粗 度Raは、1.0~1.1nmで、ほぼスタンパーの表 面粗度に近かった。また、突起のないディスク基板は2 0枚中2枚得られた。この2枚のディスク基板から、各 1.5gを切り取り、樹脂調製例1と同様にして、粒径 2. 0 μm以上の異物個数を測定したところ、9,00 0個/g及び9,100個/gであった。

【0129】比較例1

40

樹脂調製例2で得られたポリマーBを用い、実施例1と 同様にしてディスク基板を成形した。実施例1と同様 に、得られた平滑なディスク基板20枚につき、表面粗 度Ra及び高さ50nm以上の突起の有無を調べた結 果、表面粗度Raは、1.0~1.1nmで、ほぼスタ ンパーの表面粗度に近かった。また、突起のないディス ク基板は20枚中1枚も得られなかった。成形したディ スク基板中から無作為に選んだ2枚から、実施例1と同

ころ、12,000個/g及び13、000個/gであった。

【0130】比較例2

樹脂調製例 4 で得られたポリマーDを用い、実施例 1 と同様にしてディスク基板を成形した。実施例 1 と同様に、得られた平滑なディスク基板 2 0 枚につき、表面粗度 1 度 1 及び高さ 1 0 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の表面粗度に近かった。また、突起のないディスク基板は 1 の 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 の 1 を 1 の 1 を 1 の 1 の 1 の 1 を 1 の 1 の 1 を 1 の 1 の 1 を 1 の 1 の 1 の 1 を 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 を 1 の

【0131】この比較01で得られたディスク基板について、突起部分の周囲を切削除去し、突起の高さと突起の下部に存在する粒子の直径を顕微鏡にて測定した。測定結果を図6に示す。この結果により、高さ165nm以上の突起の要因となるのは粒径2.0 μ m以上の粒子であることが推定される。

[0132]

【発明の効果】本発明に係るディスク状記録媒体用基板は、少なくともディスク状記録媒体の信号が記録される領域に対応した領域には、基板表面から測定した高さが、使用される光の波長の1/4以上となる突起が形成されていない。したがって、この基板を用いたディスク状記録媒体は、光学ヘッドとの衝突等が回避され、信頼性が大幅に向上する。

【0133】また、この基板を用いたディスク状記録媒体は、浮上型光学ヘッドを信号記録層から使用する光の波長の1/4以内の浮上量で浮上させて記録及び/又は30再生を行うようにしても、浮上型光学ヘッドとの衝突が回避されるので、高密度な記録及び/又は再生が可能となる。

【0134】さらに、このディスク状記録媒体用基板は、樹脂を射出成形して形成するようにすれば、ディスク表面にヘッド位置決め情報やアドレス情報のための凹部が設けられたディスク状記録媒体やトラック間にグルーブを有するディスク状記録媒体用の基板として、精度良く且つ容易に形成することができ、ハードディスク等で用いられているアルミニウム基板に比べて生産性良く40且つ低コストで製造することができる。

【0135】また、本発明に係るディスク状記録媒体用

基板の製造方法は、成形体中の粒径 2. $0 \mu m$ 以上の粒子の数が 10000個/g以下となるように制御して成形するようにしているので、基板表面に約 165nm以上の突起が存在しないディスク状記録媒体用基板を容易に製造することができる。

【0136】このディスク状記録媒体用基板の製造方法により製造されたディスク状記録媒体用基板は、基板表面に約165nm以上の突起が存在しないので、ディスク状記録媒体の信頼性を大幅に向上させることができる。

【0137】また、本発明に係るディスク装置は、信号が記録される領域に使用する光の波長の1/4以上の高さを有する突起が形成されていないディスク状記録媒体に対して情報信号の記録及び再生を行うようにしているので、使用する光の波長の1/4以内の浮上量で浮上する浮上型光学ヘッドが、ディスク状記録媒体に衝突して、浮上型光学ヘッドあるいはディスク状記録媒体の損傷を招いてしまうという不都合が回避され、信頼性の高い記録及び再生動作を行うことができる。

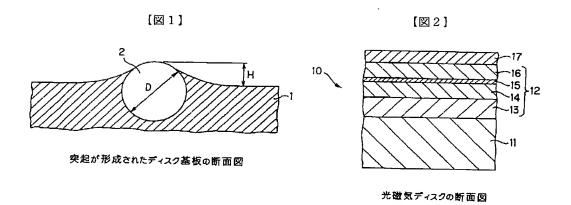
20 【0138】さらに、このディスク装置は、浮上型光学 ヘッドが、使用する光の波長の1/4以内の浮上量で浮上しながら、ディスク状記録媒体に対して情報信号の書き込み又は読み出しを行うようにしているので、光のスポット径を小さくすることができ、ディスク状記録媒体 に対して高密度で情報信号を記録し、または、高密度で情報信号が記録されたディスク状記録媒体の情報信号を再生することができる。

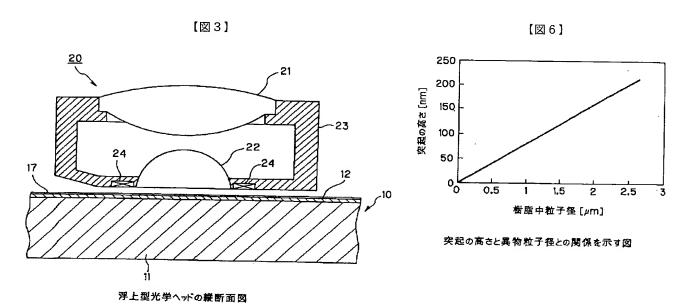
【図面の簡単な説明】

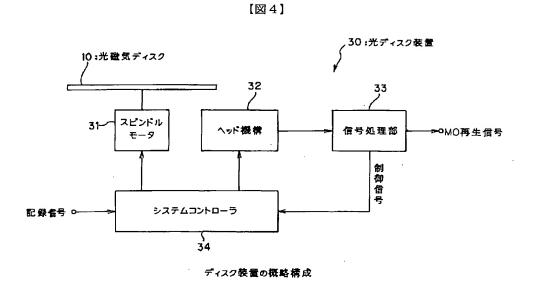
- 【図1】突起が形成されたディスク基板を示す縦断面図である。
 - 【図2】 光磁気ディスクの要部を示す縦断面図である。
- 【図3】光磁気ディスク上を浮上する浮上型光学ヘッドを示す縦断面図である。
- 【図4】光ディスク装置の概略構成を示すブロック図である。
- 【図5】光ディスク装置の要部を示す縦断面図である。
- 【図6】突起高さと異物粒子の粒径との関係を説明する図である。

【符号の説明】

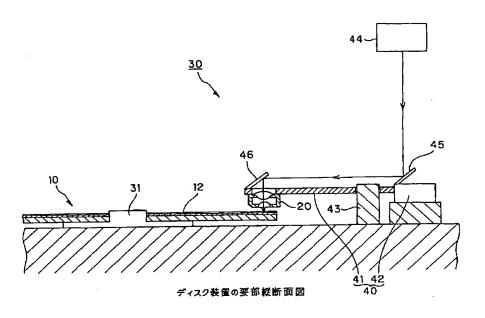
40 10 光磁気ディスク、11 ディスク基板、12 光 磁気ディスク層、17保護層、20 浮上型光学ヘッ ド、30 ディスク装置、31 スピンドルモータ







【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 大島 正義

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 日本ゼオン株式会社内

(72)発明者 小原 禎二

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株式会社総合開発センター内

(72)発明者 髙橋 治彦

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株式会社総合開発センター内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.